受託試験料金表
産学官金連携機構 設備共用部門の設備

（2023年4月）

受託試験料金は、(装置使用料×装置使用時間＋技術料×技術時間＋指導料×指導時間)×割引率＋オプション料 で計算されます。
装置使用時間は装置を使用している時間、技術時間は試料調製・測定(放置測定を除く)・作業レベルの簡単な解析・データ整理等の時間です。
材料学的な知見等を要する解析や試験結果をもとにした改善案の提案等の指導には、(一般)28,600円/時間、(高度)42,900円/時間の指導料がかかります。
一般指導料は同分野の専門家であれば一般的なレベル、高度指導料は担当教員が特に知見を有しており他の専門家では指導が難しいレベルのものです。
(アカデミア割)論文や学会等での発表を目的とした大学・国立研究開発法人等の利用で、発表の際、謝辞等に担当者名や本学名を記載頂ける場合、5割引の料金となります。
(データ提供割)測定データおよび試料データの二次利用について許諾頂ける場合、5割引の料金となります。ただし、本学が有用と認めるものに限ります。
ARIM事業の共用設備は別途割引がございます。詳細はARIM事業料金表を御覧ください。
割引は併用可能です。
オプション料は特別に測定で必要となる消耗品の実費です。
料金はすべて消費税を含んだ金額です。
ご依頼方法は https://kiki.web.nitech.ac.jp/gakugai/ から御覧ください。

測定室名	装置名、型式	性能・機能	受託試験料金(税込) (表示の他にオプション有)
物理・表面計測系			
透過型電子顕微鏡室Ⅰ	TEM (JEM-2100Plus)	加速電圧:80～200 kV、STEM、EDS、ハイコントラスト仕様	装置使用料:16,016円/時間 技　術　料:8,580円/時間
	方位解析システム (ASTER)	TEM (JEM-2100Plus)またはFE-TEM (JEM-2100F)で利用可能	装置使用料:10,296円/時間 技　術　料:8,580円/時間
透過型電子顕微鏡室Ⅱ	FE-TEM (JEM-2100F)	加速電圧:200 kV、STEM、EDS、EELS	装置使用料:21,736円/時間 技　術　料:8,580円/時間
	イオンスライサ (EM-09100IS)	傾斜角:最大±6 エッチングレート:5 mm/min (Si換算)	装置使用料:4,576円/時間 技　術　料:8,580円/時間
	精密イオンポリシングシステム (PIPS2 Model 695)	Ar+ イオンビーム	装置使用料:4,576円/時間 技　術　料:8,580円/時間
透過型電子顕微鏡室Ⅲ	3D-TEM (JEM-z2500)	エネルギー分散形X線元素分析装置付き 加速電圧:200 kV、格子像分解能:0.1 nm	装置使用料:28,600円/時間 技　術　料:8,580円/時間
	局所熱分析装置 (Nano-TA, VESTA)	分解能(高)、測定範囲:>100 nm、150 μm x 150 μm 分解能(低)、測定範囲:>1.5 μm、12 mm x 8 mm 測定温度範囲:室温～400℃、プローブ径:<30 nm、転移温度マッピング、他	装置使用料:10,868円/時間 技　術　料:8,580円/時間 ※ただしプローブは利用者負担
	ウルトラミクロトーム (Leica EM UC7, FC7)	切削ウィンドウ:0.2-14 mm、切削スピード:0.05-100 mm/s、 切片の厚さ:0-15000 nm	装置使用料:4,576円/時間 技　術　料:8,580円/時間
	凍結試料作製装置 (EM-19500 JFDⅡ)	真空度:$5x10^{-5}$ Pa以下、温度制御:+40～-170℃ 試料傾斜角度:0～90°　、蒸着材料:Pt-C、C	装置使用料:5,148円/時間 技　術　料:8,580円/時間
	TEM (JEM-1400Plus)	加速電圧:100 kV 格子像分解能:0.2 nm	装置使用料:8,580円/時間 技　術　料:8,580円/時間
透過型電子顕微鏡室Ⅳ	TEM (JEM-2100)	加速電圧:200 kV、分解能:0.23 nm	装置使用料:12,012円/時間 技　術　料:8,580円/時間
	複合ビーム加工観察装置 (JIB-4500)	SIM像とSEI像もしくはBEI像を同時に観察可能	装置使用料:7,436円/時間 技　術　料:8,580円/時間
透過型電子顕微鏡室Ⅴ	原子分解能分析電子顕微鏡 (JEM-ARM200F)	加速電圧:200 kV TEM、STEM、電子回折、エネルギーフィルター、EDS、EELS	詳細はARIM事業料金表を御覧ください
FIB-SEM室	FIB-SEM (JIB-4700F)	3D-SEM、3D-EDS、3D-EBSD、OmniProbe(TEM試料 試料室内ピックアップシステム)、STEM、大気非曝露機構	装置使用料:28,028円/時間 技　術　料:8,580円/時間
	W-SEM (JSM-IT200LA)	電子銃:タングステンフィラメント、低真空圧力:10 ～ 100 Pa EDS	装置使用料:5,720円/時間 技　術　料:8,580円/時間
	CCP (IB19520CCP)	使用ガス:Ar、イオン加速電圧:2～8kV、冷却温度設定範囲:－120～0℃	装置使用料:5,720円/時間 技　術　料:8,580円/時間
X線マイクロアナライザー室	FE-EPMA (JXA-8530F)	波長分散型X線分光器(3CH) エネルギー分散形X線元素分析装置(2CH)	装置使用料:22,880円/時間 技　術　料:8,580円/時間
	FE-SEM (JSM-7001F)	エネルギー分散形X線元素分析装置付き 結晶方位解析システム	装置使用料:14,300円/時間 技　術　料:8,580円/時間
	CP (IB09020)	常温のCP 低温を希望される場合はFIB-SEM室のCCPをご検討ください	装置使用料:4,576円/時間 技　術　料:8,580円/時間
走査電子顕微鏡室Ⅲ	L-FE-SEM (JSM-7800F)	加速電圧:0.01～30 kV、LED, UED (UEDフィルター電圧可変機能組込み) エネルギー分散形X線元素分析装置/カソードルミネセンス分析装置付き	装置使用料:24,024円/時間 技　術　料:8,580円/時間
X線分析室	XRD (SmartLab)	X線源出力:9 kW、回転対陰極式	装置使用料:5,148円/時間 技　術　料:8,580円/時間
	XRD (SmartLab SE)	X線源出力:3 kW、封入管式	
表面粗さ計室	走査型プローブ顕微鏡(SPM-9700)	コンタクトモード、ダイナミックモード、位相モード	装置使用料:4,576円/時間 技　術　料:8,580円/時間 オプション料:チップ実費
オージェ分析室	AES (JAMP-9500F)	二次電子分解能:3 nm (25 kV、10 pA) オージェ分析時最小プローブ径:8 nm (25 kV、1 pA)	装置使用料:16,588円/時間 技　術　料:8,580円/時間
光電子分光室	XPS (PHI Quantes)	デュアルソースX線源:Al Kα、Cr Kα 機能:ガスクラスターイオンビーム、中和銃、アルゴンスパッタ、 試料加熱室、トランスファーベッセル	詳細はARIM事業料金表を御覧ください
2次イオン質量分析室	TOF-SIMS (PHI TRIFTV nano TOF)	質量分解能 (無機材料):9,000M/Δμ以上 質量分解能 (有機材料):9,000M/Δμ以上 (PET(m/z 104)にて)	詳細はARIM事業料金表を御覧ください
電子顕微鏡試料作成室	FIB (JEM-9320FIB)	加速電圧:0.5～30 kV、ビーム電流:30 nA (30 kV) 分解能:6 nm (30 kV)、加工形状:矩形、ライン、スポット	装置使用料:5,720円/時間 技　術　料:8,580円/時間